**職　務　経　歴　書**

20xx年xx月xx日現在

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　○○ ○○

**■職務要約**

入社以来、●年間、次世代半導体デバイス【製品名】のドライエッチングプロセス開発に従事してきました。

また、直近の●年間は、【製品名】のプロセスインテグレーションとして、新規プロセスの立ち上げを経験しており、

自身が研究開発を担当した2製品について、製品開発部門や量産部門への技術移管と製品化に貢献しています。

直近は、プロジェクトリーダーとして、研究のとりまとめや予算やリスク管理などプロジェクト管理を経験しており、

研究者としても、常に最先端技術動向をリサーチし、新規プロセスのアイデアを発案することを心掛けています。

**■職務経歴**

□20xx年xx月～現在　 ○○○○株式会社

　◆事業内容：【半導体デバイス製品名（例NAND FLASHメモリ/DRAM/CIS/SoCなど）】の開発、製造、販売

　◆資本金：○○○百万円　売上高：○○○百万円（20xx年）　従業員数：○○○名　 上場

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 期間 | 担当製品 | 担当業務 | 環境/ツール | メンバー/役割 |
| 20xx年xx月  　～  現在 | 製品名●●のプロセスインテグレーション及び量産移管 | 【担当業務】  新規●● の新プロセス開発から立ち上げにおいて、プロセスインテグレーションの主担当及びプロジェクトリーダーを担当し、プレイイングマネージャとして、開発をリード。  【成果・実績】  ・社内として初めての●●製品について、プロセスフロー/条件を確立した。  ・●●の開発において、TCADシミュレーションを使用したデバイス最適化を行い、開発用の評価環境を新しく構築した。 | ・TCAD ・CD-SEM  ・パラメトリックアナライザー | インテグレーション担当、  プロジェクトリーダー/メンバー：10名 |
| 20xx年xx月  　～  20xx年xx月 | 次世代製品●●のドライエッチングプロセスの研究開発 | 【担当業務】  ・社内初の次世代製品●●において、絶縁膜工程のエッチングプロセス開発を担当  ・前後の工程の●●プロセスチームと協力し、●● 技術を確立  【成果・実績】  ・社内として初めての●●製品について、プロセスフロー/条件を確立した。  ・～により、課題であった●●の改善に成功。 | CD-SEM  RIE | エッチングプロセス技術開発担当、サブリーダー |
| 20xx年xx月  　～  20xx年xx月 | 製品名●●のドライエッチングプロセスの開発・評価 | 【担当業務】  ・RIEのプロセス技術開発（○○大学との共同研究）  ・プロセス条件検討及び特性評価を担当 | CD-SEM  RIE | エッチングプロセス技術開発担当 |

**■活かせる経験・知識・技術**

・次世代製品●●向けのドライエッチングプロセス技術を確立（20xx年　優秀社員賞受賞）

・プロセスインテグレーション担当として、●●の量産確立と製品化に貢献

・プロジェクトリーダーとしてプロジェクト工程管理、メンバーマネジメント、予算・リスク管理を担当

・特許出願●件、○○学会での発表、論文調査や最新動向のリサーチ活動

**■資格**

　・普通自動車運転免許（20xx年x月）

・日本英語検定試験準1級（20xx年x月）

■**語学**

・英語　TOEIC：815点

ビジネス使用経験： 10年 (文書・マニュアル読解、e-mail でのやりとり、会議、海外出張、論文査読・執筆・発表)

**■学生時代の研究テーマ**

・○○大学大学院（博士）○○研究科○○専攻（博士課程）（○○研究室）

研究テーマ／博士論文について

・○○大学大学院○○研究科○○専攻（修士課程）（○○研究室）

研究テーマ／修士論文について

・○○大学○○学部○○学科○○（○○研究室）

研究テーマ／卒業論文について

**■論文・特許・学会発表**

**●原著論文**

・申請者に下線、全員の著者名、発行年、タイトル、雑誌名、号数、ページ数、査読有無を記載。

**●総説・本**

・申請者に下線、全員の著者名、発行年、タイトル、雑誌名、号数、ページ数、査読有無を記載。

**●国際学会発表**

・発表者の前に○印、申請者に下線、全員の名前、発表タイトル、学会名、日付、場所を記載。

**●国内学会発表**

・発表者の前に○印、申請者に下線、全員の名前、発表タイトル、学会名、日付、場所を記載。

**●知的財産**

・国外特許 出願／国外特許 登録　※筆頭者について明記

・国内特許 出願／国内特許 登録　※筆頭者について明記

**■自己ＰＲ**

あまり、限定せずに簡潔に！

一貫して、次世代製品向けの新規ドライエッチングプロセス開発に従事し、また、プロセスインテグレーション担当として、

デバイスの作製プロセスから評価まで見通した研究開発から、量産への技術移管までの経験を持ち合わせていることが強みです。上記に関連する装置や関連材料についての知識も有しており、ベンダーの選定や改良提案も可能です。

研究開発においては、プロジェクトリーダーやサブリーダーとして、プロジェクトの進捗管理やメンバーとりまとめの他、

研究計画立案及び特許戦略構築を行い、自らも研究を遂行し、論文誌掲載や学会発表も経験しております。

また国プロへの参画や、社外の研究機関や大学との共同開発の経験もあり、常に新たな最先端技術を吸収し、今後も研究者として日々成長することで、新しい技術の開発や製品開発に貢献していきたいと考えています。

以上